01;06

Эффективность термоэлектрического преобразования в емкостных структурах на основе сегнетоэлектрических пленок

© В.А. Вольпяс, А.Б. Козырев, О.И. Солдатенков, Е.Р. Тепина

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), 197376 Санкт-Петербург, Россия e-mail: mcl@umwlab.com

(Поступило в Редакцию 12 сентября 2011 г.)

Численными методами исследованы тепловые режимы нагрева и охлаждения структур металлдиэлектрик-металл на основе сегнетоэлектрических пленок титаната бария-стронция с целью их применения в емкостных термоэлектрических преобразователях. Рассмотрена корреляция между тепловыми и емкостными свойствами тонкопленочных сегнетоэлектрических конденсаторов. На основе анализа динамики тепловых процессов определены время температурного отклика и инерционность изменения емкостных характеристик исследованных металл-диэлектрик-металл структур. Проведенные теплофизические расчеты учитывают реальные электрофизические свойства сегнетоэлектрических пленок титаната бария-стронция и позволяют рассчитывать параметры тепловой модуляции и эффективность емкостных термоэлектрических преобразователей на их основе.

В настоящее время наиболее эффективное преобразование энергии оптического излучения в электрическую энергию получено на основе полупроводниковых (фотоэлектрических) элементов — солнечных батерей различных типов. Общим недостатком, присущим фотоэлектрическим устройствам, является их частотная селективность, которая не позволяет преобразовывать тепловые потоки широкого спектра частот. Поэтому поиск новых принципов преобразования энергии и новых высокоэффективных материалов для преобразователей является актуальной научно-технической задачей.

Одним из перспективных методов преобразования тепловой энергии окружающей среды в электроэнергию является метод емкостного преобразования энергии [1,2]. В основе прямого преобразования тепловой энергии в электрическую с помощью электрических конденсаторов лежит следующий принцип: электрическая энергия (W), запасенная в электрическом конденсаторе емкостью C ($W = Q^2/2C$, где Q — электрический заряд в конденсаторе), увеличивается при уменьшении емкости конденсатора за счет тепловой энергии при условии, что заряд в конденсаторе остается постоянным. Для реализации емкостных преобразованией тепловой энергии в электрическую используют переменные электрические конденсаторы с механически изменяемой или температурно-зависимой емкостью и механические или оптические модуляторы теплового потока [3,4].

Особенностью исследований настоящей работы является их направленность на создание нового класса сегнетоэлектрических (СЭ) устройств преобразования инфракрасного (ИК) излучения широкого спектра (солнечное излучение, доменные печи, ядерные реакторы, электронные приборы и т.д.) в полезное электричество. В отличие от СЭ-преобразователей, принцип работы которых основан на пироэлектрических свойствах СЭ-материалов в СЭ-фазе (изменение поляризации материала при изменении его температуры), предлагаемый подход основан на использовании температурно-зависимой нелинейности материала как в СЭ, так и в параэлектрической фазах (изменение диэлектрической проницаемости материала при изменении его температуры).

Уникальные свойства СЭ — аномально высокая диэлектрическая проницаемость и резкая зависимость ее от температуры вблизи температуры фазового перехода [5,6] определяют перспективность их использования в устройствах преобразования энергии тепловых потоков. Возможность изменения диэлектрической проницаемости в емкостных СЭ-структурах типа металл/диэлектрик (сегнетоэлектрик)/металл (МДМ) (рис. 1) при периодическом тепловом воздействии позволяет осуществление замкнутого цикла преобразования тепловой энергии в электрическую и ее накопления после каждого цикла.

Электрическая мощность, генерируемая в результате термоциклирования, определяется возможностью достижения высокой частоты термоциклирования, значени-



Рис. 1. Конструкция термодинамической системы микромеханического емкостного термоэлектрического преобразователя: *1* — подвижный электрод теплового ключа (Cu); *2* — СЭ-конденсатор; *3* — тепловой поток; *4*, *5* — крайние положения теплового ключа.

ем диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика и крутизной ее температурной зависимости, нелинейностью диэлектрического отклика на воздействие электрического поля и рядом других физических, конструктивных и технологических параметров.

Проблема увеличения частоты термоциклирования связана с решением двух задач: обеспечением высокой частоты модуляции преобразуемого потока тепловой энергии и высоким быстродействием отклика МДМ-элемента преобразователя на изменение температуры.

Задача увеличения частоты модуляции падающего потока излучения может быть решена использованием электрически управляемого жидкокристаллического модулятора, обеспечивающего частоту модуляции до 10⁴ Hz [4], или микроэлектромеханического ключа, обеспечивающего частоту модуляции до 10⁵ Hz [7].

Решение второй задачи — обеспечение выского быстродействия отклика МДМ-элемента преобразователя на изменение температуры — основано на использовании тонких сегнетоэлектрических пленок в структурах МДМ, что позволяет получить малые времена нагрева и охлаждения СЭ-конденсаторов [8].

В настоящей работе приведены результаты расчетов динамики тепловых процессов в структурах МДМ на основе тонких СЭ-пленок и соответствующие им времена температурного отклика и инерционность изменения емкостных характеристик. В качестве объектов для теплофизических расчетов были выбраны тонкопленочные СЭ-конденсаторы на основе пленок (Ba,Sr)TiO₃ с реальными электрофизическими свойствами [9–11]. Исследование динамики тепловых процессов в структурах МДМ проводилось путем решения прямой задачи нестационарной теплопроводности. Моделирование иррегулярных тепловых режимов последовательных циклических процессов нагревания и охлаждения тонкой СЭ-пленки проводилось в интерактивной среде FEMLAB [12].

На основе проведенных расчетов динамики тепловых процессов в исследуемых структурах МДМ были проведены оценки частоты модуляции теплового потока и средней мощности электрической энергии, вырабатываемой емкостным термоэлектрическим преобразователем.

Рассмотрим емкостной термоэлектрический преобразователь, состоящий из нагревателя, модулятора теплового потока, имеющего вид теплопроводящей подвижной пластины (элемент МЭМС-ключа) и тонкопленочного СЭ МДМ-конденсатора, находящегося на поверхности охлаждающей подложки (рис. 1).

Подвижная пластина МЭМС-ключа под действием электростатических сил периодически с заданной частотой модуляции теплового потока перемещается от нагревателя к поверхности тонкопленочного СЭ МДМ-конденсатора, находящегося на поверхности охлаждающей подложки, и обратно. Таким образом, тепловой поток от нагревателя переносится через тонкую СЭ-пленку МДМ-конденсатора к охлаждающей подложке. Единичный цикл емкостного преобразования энергии состоит из нагрева и последующего охлаждения тонкой СЭ-пленки МДМ-конденсатора. В режимах нагрева подвижная пластина теплового ключа, имеющая однородную по всей толщине температуру нагревателя T_1 , обеспечивает тепловой контакт с верхним электродом тонкопленочного СЭ-конденсатора, имеющего однородную по всей толщине тонкой СЭ-пленки температуру, равную температуре охлаждающей подложки Т2. По истечении оптимального времени нагрева theat СЭ-конденсатора, соответствующего максимальному изменению его электрической емкости, тепловой контакт между ним и подвижной пластиной теплового ключа разрывается. Тепловой ключ возвращается к нагревателю и начинается процесс охлаждения СЭ-пленки, в течение которого электрическая емкость СЭ-конденсатора возвращается к своему первоначальному значению.

Температурное изменение диэлектрической проницаемости тонкой СЭ-пленки вызывает при неизменном электрическом заряде изменение электрической емкости СЭ МДМ-конденсатора и соответственно приводит к генерации электрической энергии, вырабатываемой емкостным термоэлектрическим преобразователем.

Рассмотрим результаты термодинамических расчетов характерных временных особенностей тепловых процессов в тонкопленочном СЭ-конденсаторе, которые и являются определяющими. В качестве тонкой пленки была выбрана СЭ-пленка $Ba_xSr_{1-x}TiO_3$ с температурой Кюри $T_C = 150-200$ К и рабочим диапазоном изменения температуры в области перехода с $\partial \varepsilon / \partial T < 0$. При этом величина относительной диэлектрической проницаемости изменялась от $\varepsilon = 1000$ при T = 300 К до $\varepsilon = 500$ при T = 330 К, что соответствует типичным параметрам рассматриваемых СЭ-пленок состава x = 0.3-0.5 [9–11].

Геометрические размеры отдельных элементов емкостного термоэлектрического преобразователя, определяющие динамику тепловых процессов, имели следующие значения:

— толщина пластины (Cu) подвижного модулятора теплового потока $l = 5 \, \mu$ m;

— диапазон толщин исследуемых СЭ-пленок $h = 0.25 - 4 \,\mu$ m;

— толщина охлаждаемой подложки (Al₂O₃) $d = 250\,\mu{\rm m}.$

Электроды СЭ-конденсатора толщиной $0.2\,\mu$ m изготовлены из Au или Pt, обладают низким тепловым сопротивлением и могут быть исключены из рассмотрения при движении теплового потока.

Моделируя процессы теплопереноса в интерактивной среде FEMLAB для режима нагрева термодинаической системы емкостного термоэлектрического преобразователя (рис. 1), получаем распределение температуры T(x, t) во всех элементах термодинамической системы. Распределение температуры и соответствующее ей распределение величины относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x)$ по глубине СЭ-пленки *h* при различных значениях времени ее нагрева приведено на рис. 2.



Рис. 2. Распределение температуры (*a*) и соответствующее ей распределение величины относительной диэлектрической проницаемости (*b*) по глубине СЭ-пленки $Ba_xSr_{1-x}TiO_3$ толщиной 1μ m при различных значениях времени ее нагрева: $I - 0.1, 2 - 0.5, 3 - 1\mu$ s.

Для конденсатора, в котором распределение диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x)$ имеет непрерывный характер, величина его емкости C определяется выражением

$$\frac{1}{C} = A \int_{0}^{n} \frac{dx}{\varepsilon(x)},$$

где *А* — геометрический фактор емкости.

Изменение диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x)$ в СЭ-пленке Ва_xSr_{1-x}TiO₃ в результате ее нагрева приводит к изменению величины емкости *C* тонкопленочного СЭ-кондденсатора. После нагрева конденсатора тепловой контакт между его верхим электродом и подвижным тепловым ключом МЭМС разрывается и начинается процесс его охлаждения. После интегрирования зависимости относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon(x)$ по глубине СЭ-пленки для различных значений времени ее нагрева и охлаждения в единичном термодинамическом цикле получаем зависимость величины относительной емкости $C(t)/C_0$ тонкопленочного СЭ-конденсатора от времени его нагрева и охлаждения при последующем термоциклировании (рис. 3).

Анализ последующих термодинамических циклов n "нагрев-охлаждение" тонкопленочного СЭ-конденсатора при тех же значениях времени нагрева и охлаждения показывает, что начальное значение величины относительной емкости $C(t)/C_0$ в режиме последующего нагрева уменьшается от ее первоначального значения цикле на величину "остаточной" в предыдущем $\Delta(C(t)/C_0).$ относительной емкости Изменение величины "остаточной" относительной емкости $\Delta(C(t)/C_0)$ при последующем термоциклировании определяется изменением значения температуры на границе пленка-подложка T_{f-s}. Если в начале первого термодинамического цикла "нагрев-охлаждение" тонкопленочного СЭ-конденсатора температура на границе пленка-подложка $T_{f-s} = 300 \, \text{K}$, то после $10 \, \mu \text{s}$ в конце первого цикла $T_{f-s} \approx 301.5$ К. При последующем термоциклировании с периодом термодинамического цикла "нагрев-охлаждение", равным 10 µs, температура на границе пленка-подложка постепенно увеличивается и достигает максимального значения $T_{f-s} = 309 \,\mathrm{K}$ после примерно 10 циклов (переходный процесс) (рис. 4). Величина "остаточной" относительной емкости зависит



Рис. 3. Зависимость величины относительной емкости $C(t)/C_0$ тонкопленочного СЭ-конденсатора от времени в двух последующих термодинамических циклах "нагрев—охлаждение": 1 — остаточная $\Delta C(t)/C_0 = 7\%$ при охлаждении за 5 µs, 2 — остаточная $\Delta C(t)/C_0 = 4\%$ при охлаждении за 5 µs.



Рис. 4. Изменение температуры на границе пленка-подложка при термоциклировании с частотой: *1* — 80, *2* — 100, *3* — 250 kHz.

Журнал технической физики, 2012, том 82, вып. 6

от теплофизических и геометрических свойств охлаждающей подложки и для подложки, обладающей меньшим тепловым сопротивлением, величина "остаточной" относительной емкости имеет меньшее значение.

При термоциклировании с частотой до $f \approx 80 \, \text{kHz}$ температура на границе пленка-подложка в конце каждого цикла $T_{f-s} = 300 \,\mathrm{K}$ и диапазон изменения температуры Т по глубине СЭ-пленки остается неизменным и составляет 300-330 К (330 К — температура теплового ключа, 300 К — температура подложки). При увеличении частоты термодинамической модуляции выше 80 kHz температура на границе пленка-подложка растет и соответственно уменьшается диапазон изменения температуры по глубине СЭ-пленки, что приводит к снижению коэффициента температурной перестройки емкости $k = C_0/C(t)$. При термоциклировании с частотой 100 kHz рабочий диапазон изменения температуры СЭ-конденсатора после переходного процесса составляет 309-330 К. Если в начальный момент времени градиент температуры по всей толщине СЭпленки составлял $\Delta T = 30 \, \text{K}$, то после переходного процесса $\Delta T = 21$ К. При этом коэффициент температурной перестройки емкости уменьшается соответственно от k = 1.48 до k = 1.42. При увеличении частоты термодинамической модуляции до 250 kHz температура на границе пленка-подложка при последующем термоциклировании достигает максимального значения $T_{f-s} = 313$ К. В этом случае установившийся градиент температуры по всей толщине СЭ-пленки составляет $\Delta T = 17 \, \mathrm{K}$, и коэффициент температурной перестройки емкости уменьшается до значения k = 1.32.

Таким образом, инерционность изменения емкостной характеристики термоэлектрического преобразователя определяется тепловыми процессами на границе пленки-подложки в режиме его охлаждения. Если в качестве подложки использовать материал, обладающей меньшим тепловым сопротивлением, то период термодинамического цикла сокращается и соответственно увеличивается частота термодинамической модуляции. Уменьшение времени термодинамического цикла, как цикла преобразования тепла в электрическую энергию, увеличивает среднюю электрическую мощность на выходе емкостного термоэлектрического преобразователя.

Приведенные результаты термодинамических расчетов характерных временных особенностей тепловых процессов в тонкопленочном СЭ-конденсаторе позволяют провести оценочный расчет мощности генерируемой электрической энергии.

Средняя электрическая мощность, генерируемая при емкостном термоэлектрическом преобразовании, определяется выражением

$$P = 0.5(k-1)C_{\max}U_0^2 f,$$

где C_{\max} — максимальная величина изменяемой емкости $(C_{\max} \approx C_0), k = C_{\max}/C_{\min}$ — коэффициент температурной перестройки емкости, U_0 — напряжение на конденсаторе с емкостью C_0, f — частота термодинамической

модуляции $(f = 1/\Delta t), \Delta t$ — период термодинаического цикла "нагрев-охлаждение".

Для рассмотренного емкостного термоэлектрического преобразователя с тонкопленочным конденсатором на основе СЭ-пленки $Ba_x Sr_{1-x} TiO_3$ толщиной $1 \mu m$, площадью 1 mm^2 и исходными величинами $C_0 = 1.0 \text{ nF}$ и $U_0 = 7.0 \text{ V}$ были получены следующие термодинамические параметры:

— период термодинамического цикла "нагрев-охлаждение" $\Delta t = 10 \,\mu$ s, что соответствует частоте термодинамической модуляции $f = 100 \,\text{kHz}$;

— коэффициент температурной перестройки емкости k = 1.42 (при f = 100 kHz).

В этом случае средняя электрическая мощность, генерируемая емкостным термоэлектрическим преобразователем, составляет $P \approx 1 \, \mathrm{mW}$. При интегрировании ряда емкостных термоэлектрических преобразователей в единую систему средняя электрическая мощность может составить $P \approx 1 \, \text{kW/m^2}$. При заданных емкостных характеристиках тонкопленочного СЭ-конденсатора повышение средней электрической мощности $P \approx (k-1)f$ возможно за счет увеличения частоты термодинамической модуляции f. Однако величина коэффициента температурной перестройки емкости k остается неизменной в частотном диапазоне до значения 80 kHz, которому соответствует пропорциональный рост средней электрической мощности P от частоты f. При увеличении частоты выше значения 80 kHz уменьшается диапазон градиента температуры ΔT по толщине СЭ-пленки на каждом цикле n (рис. 4) и соответственно уменьшается величина коэффициента температурной перестройки емкости k. Для рассматренного тонкопленочного СЭ-конденсатора средняя электрическая мощность $P \approx (k-1)f$ достигает максимального значения $P \approx 2.3 \, \mathrm{kW/m^2}$ при частоте термодинаической модуляции $f \approx 340 \, \mathrm{kHz}$ и затем уменьшается (рис. 5).



Рис. 5. Зависимость средней электрической мощности, генерируемой при емкостном термоэлектрическом преобразовании, от частоты модуляции внешнего теплового потока: $I - P \propto f$, k = const; $2 - P \propto (k - 1)f$, k = f(t).

Максимальное значение $P \approx 2.3 \, \rm kW/m^2$ — это то предельное значение средней электрической мощности, которое может генерировать рассмотренный емкостной термоэлектрический преобразователь при заданных емкостных и теплофизических параметрах. При дальнейшем увеличении частоты термодинамической модуляции, что соответствует увеличению мощности, подаваемой на СЭ-конденсатор, мощность, вырабатываемая емкостным преобразователем, будет уменьшаться и соответственно будет уменьшаться коэффициент полезного действия емкостного термоэлектрического преобразователя.

Таким образом, в результате проведенных термодинамических исследований показано, что при генерации емкостным термоэлектрическим преобразователем электрической энергии в рабочем диапазоне мощности теплового потока существует предельная электрическая мощность, определяемая емкостными и теплофизическими параметрами СЭ-конденсатора.

Основным сдерживающим фактором увеличения предельного значения генерируемой электрической мощности в заданных диапазонах изменения приложенного напряжения и мощности теплового потока является температура на границе пленка-подложка емкостного преобразователя. С одной стороны, она ограничивает рабочий диапазон температуры СЭ-конденсатора и, следовательно, диапазон температурной перестройки его емкости. С другой стороны, она ограничивает период термодинамического цикла "нагрев-охлаждение" и соответственно частоту термоциклирования емкостного преобразования энергии.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 гг. и аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)".

Список литературы

- Childress J.D. // J. Appl. Phys. 1962. Vol. 33. N 5. P. 1793–1798.
- [2] Zhu H., Pruvost S., Cottinet P.J., Guyomar D. // Appl. Phys. Lett. 2011. Vol. 98. P. 222 901.
- [3] Пат. США № 4647836. МПК Н02N 1/00. Ругоеlectric energy converter and method. / Olsen R.B.; заявитель и патентообладатель Olsen R.B. — № 585426; заявл. Маг. 2, 1984; опубл. Маг. 3, 1987, 14 стр., 17 ил.
- [4] Пат. РФ № 2350008. МПК Н02N 10/00. Способ преобразования тепловой энергии в электрическую и устройство для его осуществления. / Осадчий В.Н., Косьмин Д.М., Козырев А.Б., Гинлей Д., Кайданова Т., Аверьянов А.Е.; заявитель и патентообладатель Козырев А.Б., Осадчий В.Н. — № 20071178555/06; заявл. 04.05.2007. опубл. 20.03.2009. Бюл. № 8. 9 стр., 9 ил.

- [5] Tumarkin A.V., Razumov S.V., Gagarin A.G., Kozyrev A.B. // Proc. 33rd European Microwave Conf. (EuMC 2003). Munich, Germany, 2003. P. 325–326.
- [6] Jaemo Im., Auciello O., Baumann P.K. et al. // Appl. Phys. Lett. 2000. Vol. 76. N 5. P. 625.
- [7] Варадан В., Виной Л., Джозе К. ВЧ МЭМС и их применение. М.: Техносфера, 2004. 528 с.
- [8] Пат. США № 6528898. МПК Н02Р 9.04. Ругоеlectric conversion system. / Ікига М., Charbonneau R; заявитель и пантенообладатель Her Majesty the Queen in right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources. — № 09/856480; заявл. Dec. 14, 1998; опубл. Mar. 4, 2003, 15 стр., 15 ил.
- [9] Kozyrev A., Ivanov A., Samoilova T., Soldatenkov O., Astafiev K., Sengupta L.S. // J. Appl. Phys. 2000. Vol. 88. N 9. P. 5334–5342.
- [10] Chia-Cheng Ho, Bi-Shiou Chioua, Li-Chun Chang. // Appl. Phys. Lett. 2007. Vol. 90. P. 132 906.
- [11] Zhou X.Y., Wang D.Y., Zheng R.K. et al. // Appl. Phys. Lett. 2007. Vol. 90. P. 132–902.
- [12] *Littmarck S.* et al. Math, models, motion and more, PT Desing Magazine, Penton Media (Cleveland, OH). May 2000.